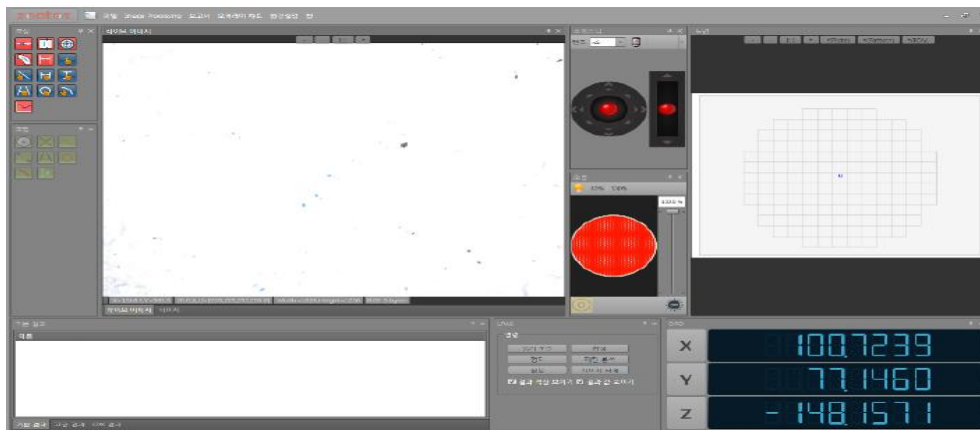


APIS

Automated Particle Inspection System

Professional Vision Solution Creator





APIS는

멤브레인 필터, 웨이퍼, 접착 테이프, 세정 작업 등에서 얻어진 입자 오염을 검사하기 위한
입자 분석 시스템입니다.

주요 특징

- 윈도우 사용자에게 친숙한 UI 제공
- 물체 추적을 이용한 단일 큰 개체의 자동 연결
- 저배율에서 고배율까지 지원
- 빠른 오토포커스(Vision AF)
- 국제 규격 지원 (ISO 16232, USP 788 등)
- 금속 비금속 검출 가능

응용 분야

- 자동차/기계 정밀 부품 청정도 검사
- 접착 테이프의 잔여물 검사
- 반도체 웨이퍼 입자 검사
- LCD/PDP 패널 입자 및 크랙 검사
- 클린룸의 대기 청정도 검사
- 의료 분야 및 파우더 입자 검사

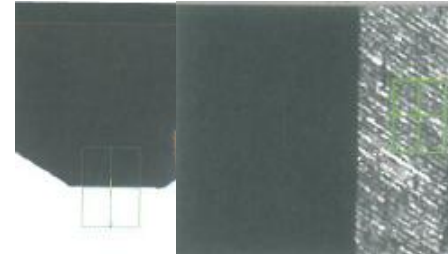
주요 특징

1 Customer Identification									
Company					Order				
Contact					Date				
Address									
2 Report and analysis identification									
Laboratory identification					Report Number		Project No.		
Date of analysis									
3 Identification of test component									
Type					Reference				
Serial Number					Serial Number				
Test conditions					Material surface area				
Number of particles analyzed					Controlled surface area				
Material surface area					Controlled volume				
Material					Controlled volume				
4 Extraction procedure									
Process					Reference No.				
Filter type					Volume				
Filter size					Membrane				
5 Microscopic Analysis Conditions									
Environment					Controlled ISO 14644-1 Class				
Microscope Type					Invert				
Reference					Camera				
Date of calibration					Software				
Type of microscope					Field size				
Magnification					Resolution				
Counting					Incident				
6 Analysis results									
Particle size (µm)					Area (µm²)				
Size class					Area class				
Particle number					Area number				
Total particle count					Total area count				
Total area count					Total particle count				
7 Observations / comments (magnification, Illumination, gray level, camera settings, etc.)									

국제 규격 지원

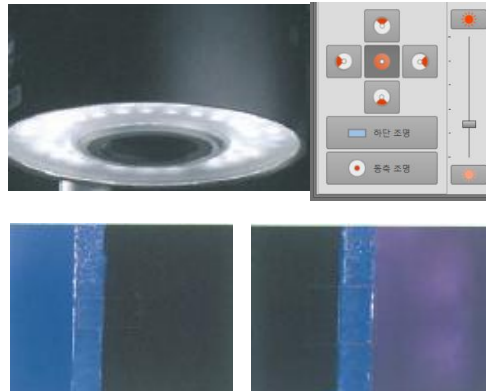
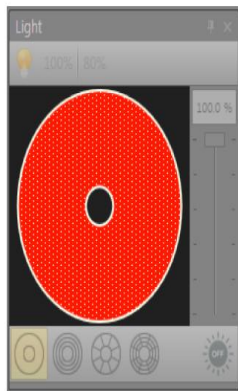
ISO 16232, ISO 4406-4407,
USP 788, IEST-STD-CC1246D

국제 규격을 지원하며,
고객사 요청을 규격을 지원



Auto Focus

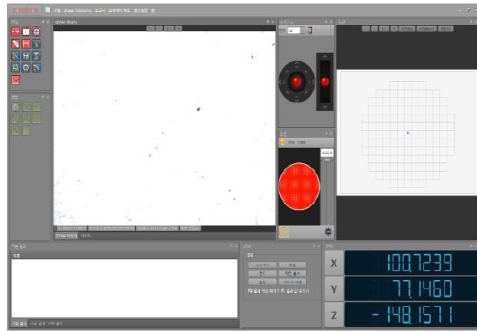
Vision A.F - 표면 거칠기 정보를
이용하여 영상 오토포커 기능을
제공



Multi Illumination

동축 반사, 편광, 투과 조명 지원
금속 소재와 비금속 검사 가능
단방향 조명 조건에서 검출 되지 않는 이
물을 검출 가능

주요 특징 *Software*



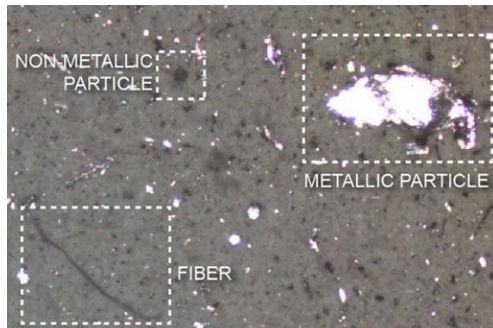
Main Layout

윈도우 사용자에게 보다 친숙한 UI를 제공한다.



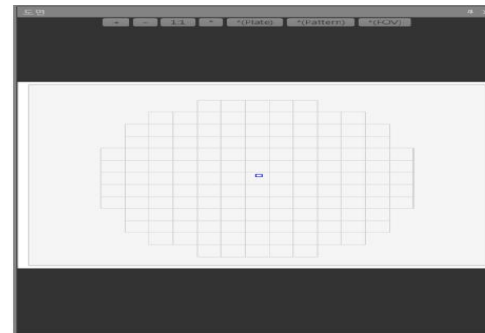
설치 및 C/S 편리성

제품 출하시 카메라, 광학 및 캘리브레이션이 미리 설정되어 있어 검사 샘플을 올려 바로 사용이 가능하다.



다양한 입자 형태 분석

24종 이상의 입자 형태를 분석할 수 있는 강력한 분석 알고리즘을 탑재하여, 표준 규격 출력을 물론, 입자의 형태에 따른 분류가 가능하다.

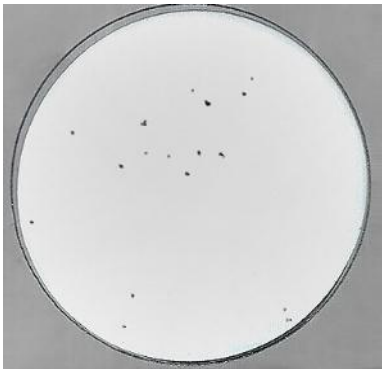


실시간 입자맵

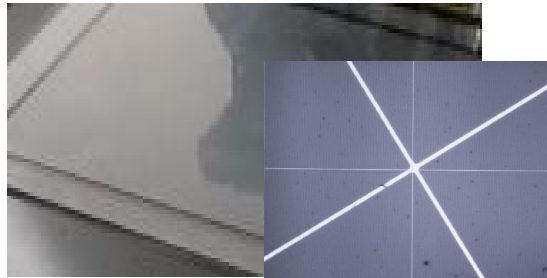
검사 중 실시간으로 검출된 입자를 출력하며, 검사가 완료된 후 전체 입자맵을 이용하여 검출 개체를 쉽게 다시 검토할 수 있다.

응용 분야

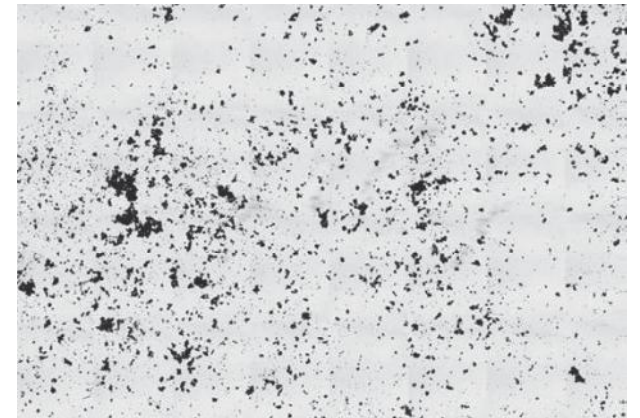
Cleanliness Analysis



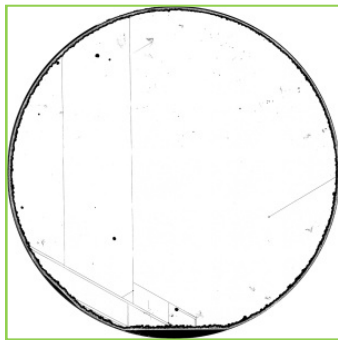
Glass Particle Inspection



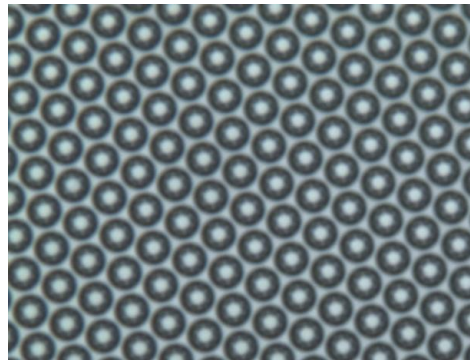
Powder Particle Analysis



Wafer Crack Analysis



Sapphire Circle Analysis



사양 *Software*

항 목	설 명
지원 규격	ISO 16232, IEST-STD-CC1246D, ISO 4406-4407, USP 788, VDA19, DIN50602, Custom Standard
레시피	명세 기준(기본값 또는 설정값)의 완벽한 입자 분석 및 처리
스캔 맵	필터를 스캔과 동시에 파티클 맵을 실시간으로 구성
지능적 탐지	낮은 Contrast Image의 정확한 탐지
명암 교정	빛의 불균형성을 소프트웨어로 처리
개체 추정	하나의 개체가 여러 영상에서 나타나는 경우 하나의 개체로 인식
군집화	개체를 크기 또는 형태별로 군집 생성 및 색상 별로 출력하는 비주얼 리포트
자동 교정	원클릭으로 캘리브레이션 완료
스테이지 패턴	사각형, 원형 스테이지 패턴 생성 지원
스케일 표시	결과 영상에 스케일 출력
고객 맞춤 기능	업체별 특성에 맞게 분석/보고서 생성

고객사

